

レーザー顕微鏡 (VK-X250 (キーエンス)) 機器見学会



キーエンス様のご厚意により、レーザー顕微鏡の機器見学会を開催します。
ご興味のある方は、どうぞご参加ください。

日時:平成29年**5月9日(火)**

15時00分～16時00分

場所:理系複合棟321室

説明担当:中本秀樹 氏 (株式会社キーエンス)

内容:レーザー顕微鏡 (VK-X250) の紹介及び観察デモ
(研究基盤センターに設置しているVK-9710の後継機種です)

参加申込は不要です。但し、観察・分析をご希望の方は、
事前に相談をお願いします。

担当者より:表面性状の”違い”を比較したいサンプルを複数ご持参
ください。分析レポートをお渡しいたします。

【分析事例の紹介】

Sa (面の算術平均高さ)

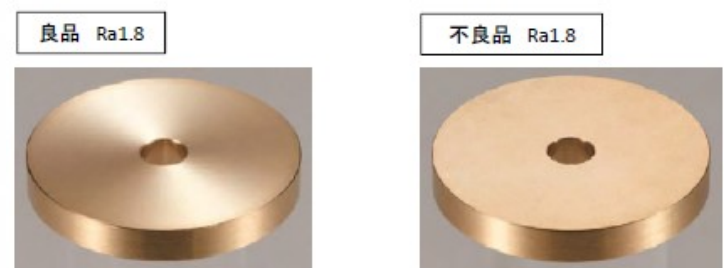


Sa		(単位:μm)
最 大		3.095
最 小		2.148
平 均		2.522
標 準 偏 差		0.374



Sa		(単位:μm)
最 大		5.155
最 小		4.954
平 均		5.023
標 準 偏 差		0.079

表面粗さ視覚化ツール



見た目や肌触りが異なるが、どんな粗さパラメータを使って
評価すればよいかわからない。Ra,Rzでは違いがない



42個の粗さパラメータから違いを抽出

問い合わせ先

研究基盤センター事務室 (理系複合棟307号室)
TEL:895-8967 E-mail:irc@lab.u-ryukyu.ac.jp

泉水仁

HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>

主催:研究基盤センター